

Doc. No.: NR080702

2008年7月2日

大日本スクリーン、Silicon Light Machines社(米国)を買収 ～世界屈指の光学技術との融合を図る～

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区／社長：橋本 正博)はこのほど、MEMS^{※1}技術を駆使したデバイス開発を行う Silicon Light Machines社(本社：米国・カリフォルニア州サンノゼ／社長兼CEO：Hal Zarem氏／以降、SLM社)の買収を完了し、新たなグループ企業として事業を展開してまいります。

SLM社は、世界的半導体業界における最先端の地、シリコンバレーを拠点とするベンチャー企業として、1994年に設立。以来、最先端技術の開発に取り組み、GLV^{TM※2}に代表される世界有数の独創的なテクノロジーは、世界的に高い評価を得ています。

当社は今回の買収により、SLM社の持つ光学MEMS分野における世界屈指の技術と、画像情報処理技術をはじめとする当社のコア技術の融合を図り、半導体、フラットパネルディスプレイ、プリント配線板事業などへの積極的な応用展開により、新事業の創出を目指してまいります。

※1 MEMS (micro-electro-mechanical systems)

半導体製造技術を応用した微小な電子機械システム、および関連技術の総称。日本では「マイクロマシン」とも呼ばれている。プロジェクターの光学素子や、インクジェットプリンターのヘッド部、各種センサーをはじめ、幅広い分野で活用されている。

※2 GLVTM (Grating Light ValveTM)

MEMSの技術と光の干渉性を利用して、光の向きや強度を制御する表示素子。半導体素子の基板上に光を反射するリボンを並行に配列した構造で、露光ビームの多チャンネル化が図れる。

* GLVTMおよびGrating Light ValveTMは、Silicon Light Machinesの商標です。